

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成22年1月28日(2010.1.28)

【公開番号】特開2008-218206(P2008-218206A)

【公開日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【年通号数】公開・登録公報2008-037

【出願番号】特願2007-54211(P2007-54211)

【国際特許分類】

H 05 B 33/04 (2006.01)

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

G 09 F 9/30 (2006.01)

【F I】

H 05 B 33/04

H 05 B 33/10

H 05 B 33/14 A

G 09 F 9/30 3 0 9

【手続補正書】

【提出日】平成21年12月1日(2009.12.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一对の電極の間に電気光学層が挟持されてなる複数の画素を有する基板と、

前記基板に対向配置され、前記基板にシール剤層を介して接着される封止部材とを備えた電気光学装置において、

前記基板あるいは前記封止部材の少なくとも一方の前記シール剤層の形成領域に光触媒層が形成されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項2】

前記光触媒層は酸化チタンからなることを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。

【請求項3】

前記光触媒層が前記基板と前記シール剤層との間、及び前記封止部材とシール剤層との間に形成されていることを特徴とする請求項1または請求項2記載の電気光学装置。

【請求項4】

一对の電極の間に電気光学層が挟持されてなる複数の画素を有する基板と、

前記基板に対向配置され、前記基板にシール剤層を介して接着される封止部材とを備えた電気光学装置の製造方法であって、

前記基板あるいは前記封止部材の少なくとも一方に光触媒層を形成する工程と、

前記光触媒層上にシール剤層を塗布する工程と、

前記シール剤層を介して前記基板と前記封止部材とを接着する工程とを有することを特徴とする記載の電気光学装置の製造方法。

【請求項5】

前記光触媒層は酸化チタンからなることを特徴とする請求項4に記載の電気光学装置の製造方法。

【請求項6】

前記シール剤層の塗布工程において、前記シール剤層の形成材料をインクジェット法により塗布することを特徴とする請求項4または請求項5に記載の電気光学装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】電気光学装置及びその製造方法

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

本発明は、電気光学装置及びその製造方法に関するものである。